

Source container QG2000



利点:

- シンプルで扱いやすい安全規格で最も厳しい条件を満足する線源 (DIN 25426/ISO2919 分類C66646)
- 非常に高い遮蔽能力で軽めの重量。通常は管理区域が要らず、アクセスできる範囲を保ったままの設置が可能。
- Oリング付きの追加保護容器によって、機械的、化学的影響から線源を保護
- 省スペース、シンプル取付コンセプト。アプリケーションに応じて最適な放射角度の設定が可能
- オン/オフスイッチの状態を固定、および盗難から保護するための南京錠
- 線源容器のシャッター状態はカバー上のガラス窓、または近接スイッチを使用したりリモート表示器で確認が可能

詳細情報と現在の価格は以下をご覧ください:

www.jp.endress.com/QG2000

仕様一覧

- プロセス温度 制限なし
- プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット 制限なし
- 主要接液部 非接触

アプリケーション: 線源容器 QG2000 は、放射線式リミットスイッチ、レベル測定および密度測定時に線源を収納しておくための容器です。放射線は、1方向にのみに照射され、その他の方向は鉛で減衰するような構造になっています。これにより、作業員の高い安全性と測定の信頼性を確保します。

機能と仕様

連続 / 粉粒体

測定原理
放射線式

連続 / 粉粒体

特性 / アプリケーション

線源容器

放射角度: 40 / 20 度

350kg

特徴

アプリケーションによる管理区域計算

周囲温度

-20 °C...+200 °C

(-4 °F ... +392 °F)

プロセス温度

制限なし

プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

制限なし

主要接液部

非接触

プロセス接続

非接触

後継機種

FQG66

リミットスイッチ / 粉粒体

測定原理

放射線式

特性 / アプリケーション

線源容器

放射角度: 5度

350kg

リミットスイッチ / 粉粒体

特徴

アプリケーションによる管理区域計算

周囲温度

-20 °C...+200 °C

(-4 °F...+392 °F)

プロセス温度

制限なし

プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

ト

制限なし

主要接液部

非接触

プロセス接続

非接触

サニタリ プロセス接続

非接触

後継機種

FQG66

密度

測定原理

放射線式

特性 / アプリケーション

線源容器

放射角度: 20 / 40度

350kg

周囲温度

-20 °C...+200 °C

密度

プロセス温度
制限なし

プロセス圧力 (絶対圧力)
制限なし

接液部
非接触

サニタリ
非接触

特徴
アプリケーションによる管理区域計算

後継機種
FQG66

リミットスイッチ / 液体

測定原理
放射線式

特性 / アプリケーション
線源容器
放射角度: 5度
350kg

特徴
アプリケーションによる管理区域計算

周囲温度
-20 °C...+200 °C
(-4 °F...+392 °F)

プロセス温度
制限なし

リミットスイッチ / 液体

プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
制限なし

主要接液部
非接触

サニタリ プロセス接続
非接触

後継機種
FQG66

連続 / 液体

測定原理
放射線式

特性 / アプリケーション
線源容器
放射角度: 40 / 20 度
350kg

特徴
アプリケーターによる管理区域計算

周囲温度
-20 °C...+200 °C
(-4 °F...+392 °F)

プロセス温度
制限なし

プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
制限なし

主要接液部
非接触

連続 / 液体

プロセス接続
非接触

後継機種
FQG66

詳細情報 www.jp.endress.com/QG2000